

装置・技術担当者一覧

総責任者： 入船 徹男

A. センター設置装置・技術

| I. 超高压装置群（超高压実験装置と関連装置） | | [通称] | [装置型番] | [管理・実施責任者] |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| (1) | マルチアンビル超高压発生装置 | Orange-1000 | | 西原遊, 新名亨 |
| (2) | マルチアンビル超高压発生装置 | Orange-3000 | | 大内智博, Steeve Gréaux, 新名亨 |
| (3) | D-DIA型超高压変形装置 | Madonna I | | 大内智博, 西原遊, 新名亨 |
| (4) | DIA型焼結ダイヤモンドアンビル超高压装置 | Madonna II | | 西真之, 新名亨 |
| (5) | ダイヤモンドアンビルセル | DAC | | 境毅, 大藤弘明 |
| (6) | DAC用ファイバーレーザー加熱システム | Fiber laser | | 境毅, 大藤弘明 |
| (7) | DAC用CO ₂ レーザー加熱システム | CO ₂ laser | | 境毅, 大藤弘明 |
| (8) | マルチアンビル装置用高圧下弾性波速度測定装置 | Ultrasonic | TDS5104 | 河野義生, Steeve Gréaux |
| II. 微小試料分析装置（電子顕微鏡および関連装置とX線回折・分光装置等） | | | | |
| (9) | 電界放出型走査電子顕微鏡（EDS付き） | FE-SEM-EDS | JSM-7000F | 大藤弘明, 大内智博 |
| (10) | 電界放出型走査電子顕微鏡（EBSD付き） | FE-SEM-EBSD | JSM-7000F | 大藤弘明, 大内智博 |
| (11) | 走査型電子顕微鏡（EDS付き） | SEM-EDS | JSM-6510LV | 大藤弘明, 大内智博 |
| (12) | 電界放出型透過電子顕微鏡（EDS付き） | FE-TEM | JEM-2100F | 大藤弘明, 西真之 |
| (13) | 透過型電子顕微鏡 | TEM | JEM-2010 | 大藤弘明, 大内智博 |
| (14) | 集束イオンビーム（デュアルビーム）加工装置 | Dual Beam FIB | Scios | 大藤弘明, 境毅 |
| (15) | 集束イオンビーム加工装置 | FIB | JEM-9310FIB | 大藤弘明, 境毅 |
| (16) | 微小領域X線回折装置 | Micro-focus XRD | RAPIDII-V/DW | 境毅, 大藤弘明, 新名亨 |
| (17) | 粉末X線回折装置 | Powder XRD | UltimaIV/DD | 大藤弘明, 新名亨, 境毅 |
| (18) | 顕微ラマン分光装置（日本分光） | Micro-Raman Spectroscopy | NRS-5100gr | 境毅, 大藤弘明, 新名亨 |
| (19) | 顕微ラマン分光装置（Photon Design） | Micro-Raman Spectroscopy | RSM 800 | 境毅, 大藤弘明, 新名亨 |
| (20) | 顕微近赤外レーザーラマン分光装置 | Micro-Raman (NIR) Spectroscopy | NRS-4500 | 境毅, 大藤弘明, 新名亨 |
| (21) | 顕微赤外分光装置 | FT-IR | Spectrum One | 西原遊, 新名亨 |
| (22) | 紫外可視近赤外分光システム | UV-Vis-NIR | V-670 | 大藤弘明, 新名亨 |
| (23) | レーザー顕微鏡 | Laser microscope | OPTELICS HYBRID L3 | 大藤弘明, 新名亨 |
| (24) | イオン研磨加工装置（イオンスライサ） | Ion Slicer | EM-09100 IS | 大内智博, 大藤弘明 |
| (25) | イオン研磨加工装置（クロスセクションポリッシャー） | Cross Section Polisher | IB-19510CP | 大藤弘明 |
| (26) | イオン研磨加工装置（アルゴンイオンミリング） | PIPS | Model 691 | 大内智博, 大藤弘明 |
| | オスミウム・白金・金・カーボン蒸着装置 | Coater | Neoc-STB/JFC-1600/JEC-560 | 大藤弘明, 大内智博 |
| III. 加工装置・その他の特徴ある装置 | | | | |
| (27) | 超音波加工機 | | UM-150CS | 西原遊, 大内智博 |
| (28) | 自動パーツ加工機① | | MDX-540 | 西真之, 新名亨, Steeve Gréaux |
| | 自動パーツ加工機② | | MDX-40a | 西原遊, 新名亨, 西真之, Steeve Gréaux |
| (29) | 高温雰囲気炉① | 大型炉 | ATCM50-100/1700 | 大内智博, 新名亨 |
| (29) | 高温雰囲気炉② | 小型炉 | TS-4B06 | 西原遊, 新名亨 |
| (30) | マイクロビッカース硬度計 | | HMV-G21DT | 大藤弘明, 新名亨 |
| | 大型平面研磨盤 | | GS-BMHF | 新名亨 |
| | 精密ボール盤 | | JIG-3M-1 | 西原遊, 新名亨, 大内智博 |
| | コンターマシン | | V-33 | 西原遊, 新名亨 |
| | 自動研磨機 | | EcoMet3000 | 西原遊, 新名亨, 大藤弘明 |
| | ファイバーレーザー加工装置① | DAC用 | FL-LM 01 | 境毅, 新名亨 |
| | ファイバーレーザー加工装置② | MA用 | ML-7111A | 西原遊, 新名亨 |
| | ダイヤモンド研磨機 | | MCBS-320 | 入船徹男, 新名亨 |
| | 大型NCタッピング装置 | | MTV-T310; KIRA, PCV-30 | 新名亨 |
| | CCD形状観察装置（キーエンス） | | VHX-2000 | 大藤弘明, 新名亨 |
| | デジタルマイクロスコープ（ライカ） | | DVM6 | 大藤弘明, 新名亨 |
| IV. 数値計算用コード | | | | |
| (31) | 絨物物性シミュレーションコード | | | 土屋卓久, 出倉春彦 |
| (32) | 数値流体シミュレーションコード | | | 亀山真典 |
| V. センター外設置装置・技術 | | | | |
| (33) | 変形機構付きガイドブロック（Spring-8 BL04B1 ビームライン） | | | 西原遊, 大内智博 |
| (34) | X線その場観察弾性波速度測定装置（Spring-8 BL04B1 ビームライン） | | | 河野義生, Steeve Gréaux |
| VI. センター合成のナノ多結晶ダイヤモンド（ヒメダイヤ） | | | | |
| | 各種の応用研究用としてヒメダイヤの合成ならびに最適加工 | NPD | | 入船徹男, 新名亨 |